

別紙

マイクロンメモリ ジャパン株式会社 Fab15温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

マイクロンメモリ ジャパン株式会社 Fab15

(2) 事業所の所在地

広島県東広島市吉川工業団地7番10号

(3) 業種

集積回路製造業 (2814)

2 計画の期間

期 間：平成25年度 (2013年度)

基準年度：平成15年度 (2003年度)

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況
 《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO₂) , 削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量(a) 平成15年度	目標年度 上段：見込量(b) 下段：削減率(c) 平成25年度	計画期間の実績 (上段：実排出量(d), 下段：削減量の対基準年度比(e))				
			平成25年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO ₂							
非エネルギー 起源CO ₂							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類	220,909	200,000 9.5%	186,494 15.6%				
温室効果ガス 実排出量総計	220,909	200,000 9.5%	186,494 15.6%				
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価	フロン類の排出目標について、目標達成。 ・対象ガス：PFC (CF ₄ , C ₂ F ₆ , C ₃ F ₈ , C ₄ F ₈) , HFC (CHF ₃) , SF ₆ , NF ₃ の7種類合計 ・温暖化係数は2001年制定値使用 (半導体業界基準)						

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： 生産量 (枚)

温室効果ガスの種類	基準年度の実績(a) 平成15年度	目標年度 上段：目標(b) 下段：削減率(c) 平成25年度	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d), 下段：削減量の対基準年度比(e))				
			平成25年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO ₂	0.28	0.15(見込み) 44%以上	0.15 46%				
非エネルギー 起源CO ₂							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 総排出量	0.28	0.15(見込み) 44%以上	0.15 46%				
エネルギー消費 原単位 (原油換 算kl)	3503		62.6 98.2				
実績に対する 自己評価	エネルギー起源CO ₂ について、大規模コージェネレーションシステム導入、生産効率の追及、施設のエネルギー効率改善等により原単位目標達成継続。						

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	エネルギー原単位の改善	CO ₂ 排出量・ウェハ投入枚数原単位03年度下期比54%以下	高効率CGSの稼働、生産性の向上
2	PFC使用量の削減	PFC使用量03年度下期比90%以下 (生産規模は370%以上に拡大)	排ガス除害装置の積極導入及び安定稼働
3			
4			

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

○ その他の取組み

	項目	数値目標	具体的な取組み
1	化学物質使用量原単位の改善	化学物質使用量ウェハ投入枚数原単位03年度下期比67%以下	原材料使用量の削減 排水処理薬品使用量の削減 生産性の向上
2	水使用量原単位の改善	水購入量ウェハ投入枚数原単位03年度下期比65%以下	水資源回収再利用推進 生産性の向上
3	廃棄物排出量原単位の改善	廃棄物排出量ウェハ投入枚数原単位03年度下期比77%以下	原材料使用量の削減 排水処理薬品使用量の削減 廃棄物の適正処理、生産性の向上

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。